

AK Plasma – Fachausschuß Normung

Bericht Herbstsitzung 2006 Jena

- VDI
- DIN
- ISO
- CEN

FA 3.42 Nichtgeometrische Messgrößen

„Analytik an organischen Oberflächen“

Zielstellung:

*Entwicklung von validierten Analyse-Verfahren (“Protokolle”), mit deren Hilfe vergleichbare Messergebnisse bei der **Bestimmung von Funktionalgruppen, Radikalen,... an chemisch komplexen Oberflächen** erreicht werden können.*

Mitarbeit aus der Industrie:

TASCON (Münster), **IFOS** (Kaiserslautern), **Bayer Technology Services GmbH** (Leverkusen)

Mitarbeit aus Instituten:

BAM (Berlin), **MPI-P** (Mainz), **FhG IOT/IST** (Braunschweig), **FhG IGB** (Stuttgart)

FhG IAP (Golm), **IPF** (Dresden), **INP** (Greifswald)

Treffen : PSE 2006, 11.9.2006 ; AK Plasma, Jena, 22.11.2006

Zukünftig u.a. im Fachausschuss „Plasmabehandlung von Polymeren“ des AK Plasma.

**Interessenten wenden sich an
Dr. Wolfgang Unger, BAM VI.4 „Oberflächentechnologien“
Email: wolfgang.unger@bam.de ; Tel.: 030 8104-1823**

1. Arbeitsthema:

Quantitative Bestimmung von Funktionalgruppen in komplexer Umgebung

Verfahren: ESCA, ToF-SIMS, Fluoreszenzverfahren (weitere?)

	Amino-Gr.	Hydroxyl-Gr.	Epoxy-Gr.	Karboxyl-Gr.
Protokolle: Direkte Bestimmung	Ja (homofunktionalisierte Proben)	Ja (homofunktionalisierte Proben)	Ja (homofunktionalisierte Proben)	Ja (homofunktionalisierte Proben)
Protokolle: Markertechnik	Ja, (komplexe Proben)	Ja, (komplexe Proben)	Ja, (komplexe Proben)	Ja, (komplexe Proben)
Ref.-Mat. oder Kits	offen	offen	offen	offen
Ringversuche	Ja, Ringversuchprobe?	Ja, Ringversuchprobe?	Ja, Ringversuchprobe?	Ja, Ringversuchprobe?
Normung	Erfolgreiches Protokoll – VDI Richtlinie	Erfolgreiches Protokoll – VDI Richtlinie	Erfolgreiches Protokoll – VDI Richtlinie	Erfolgreiches Protokoll – VDI Richtlinie
Rückführbarkeit, Meßunsicherheit	Evaluierung durch BAM	Evaluierung durch BAM	Evaluierung durch BAM	Evaluierung durch BAM

Guideline VDI/VDE 2656 Part 1 (Draft): Determination of geometric quantities by Scanning Probe Microscopes – Calibration of Measurement Systems

... describes procedures for the traceable calibration and characterisation of Scanning Probe Microscopes (SPM). The application of these procedures is therefore a precondition for traceable measurements of geometric properties by SPM.

Guideline VDI/VDE 2656 Part 1 wurde auf der letzten Sitzung des ISO/TC 201 am 28.9.2006 im SC9 als Vorschlag für NWIP eingebracht (Dziomba, PTB).

Spiegelgremium zu ISO/TC 229 Nanotechnologies + CEN/TC 352 Nanotechnologies

ISO/TC 229 Nanotechnologies (Chair: Dr. Peter Hatto, UK)

Working Groups

WG1: Terminology & Nomenclature (convenor : Canada)

WG2: Measurement & Characterization (convenor : Japan)

WG3: Health, Safety, and Environmental Aspects of Nanotechnologies
(convenor : USA)

Next Meeting: 04.-07.12.2006, Seoul

Deutsche Delegation: Dr. Engel (BASF), Dr. Pridöhl (Degussa), Prof. Bergholz (Int.Uni Bremen), Fr. Dr. Maier (Degussa), Dr. Meyer (Bayer Technologies), Reiners (BAM), Dr. Stintz (TU Dresden), Dr. Schmitt (DIN), Dr. Voetz (Bayer Technologie)

NWIP „Terminology and definitions for nanoparticles“

NMIP zur Charakterisierung von Fullerenen, MWNTs und SWNTs zur Abstimmung.

TR zum Stand der Technik im Bereich "Occupational safe practices" ist beschlossen.

Das übernächste Meeting findet vom 04. bis 08. Juni 2007 in Berlin statt.

Spiegelgremium zu ISO/TC 229 Nanotechnologies + CEN/TC 352 Nanotechnologies

CEN/TC 352 Nanotechnologies (Chair: Dr. Trudy Phelps, UK)

Gründungssitzung 05.04.2006, Brüssel

P-Member: Austria, Belgium, Denmark, **Finland**, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, **Poland**, **Spain**, Sweden, United Kingdom

O-Member: Czech Republic, **Slovakia**, **Switzerland**,

Business Plan

CEN/TC 352 will engage in standardization in the field of nanotechnologies.

This will include the preparation of standards for classification, terminology and nomenclature, basic metrology, measurement and characterization (including procedures for calibration), health, safety and environmental issues.

letzte Sitzung: 04.10.2006, BAM, Berlin

Der deutsche Spiegelausschuß nimmt eine kritische Haltung zu den Aktivitäten dieses Gremiums ein. Man ist bestrebt, möglichst alle Aktivitäten auf ISO-Ebene zu konzentrieren.